

부식성 산 분해용 PTFE 에칭 및 벤치 보호 기능을 갖춘 맞춤형 흑연 가열판

품목 번호: PL-CP110



소개

뛰어난 내식성과 단열성을 위한 보호용 PTFE 에칭이 특징인 정밀 설계 맞춤형 흑연 가열판입니다. 산 분해 및 미량 분석에 최적화된 이 시스템은 까다로운 실험실 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장하면서 민감한 작업 표면을 보호합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
환경 토양 분석	농축 질산 및 과염소산을 사용한 토양 및 퇴적물 시료의 대규모 분해.	부식성 증기에 강하며 수백 개의 시료를 동시에 균일하게 가열합니다.
미량 금속 검출	오염이 제어되어야 하는 ICP-MS 시료 준비를 위한 PFA 및 PTFE 용기 가열.	고순도 재료가 교차 오염을 방지하고 분석 정확도를 보장합니다.
지구화학 탐사	불산을 포함하는 가혹한 현장 실험실 조건에서 광석 및 암석 시료 처리.	PTFE 에칭이 흑연 코어의 산 손상을 방지하여 원격 현장에서 장비 수명을 연장합니다.
식품 안전 검사	납, 카드뮴, 수은과 같은 중금속 검출을 위한 유기 매질의 습식 분해.	일관된 열 분포가 복잡한 유기물의 완전한 분해를 보장합니다.
반도체 세정	웨이퍼 세정 및 에칭 공정을 위한 고순도 화학 용액 가열.	탁월한 화학적 불활성으로 공정이 금속 이온으로부터 자유롭게 유지됩니다.
계약 품질 관리	유효 성분 시험 중 휘발성 용매의 증발 및 농축.	정밀한 온도 제어가 열에 민감한 제약 화합물의 분해를 방지합니다.
야금학 연구	원소 구성 확인을 위한 합금 시료의 산 침출 및 용해.	견고한 표면이 무거운 용기를 처리하고 고온 하중 하에서 안정성을 유지합니다.

특징	사양 세부사항 (모델: PL-CP110)
기본 재료	고순도 등방성 흑연
보호 에칭 재료	실험실 등급 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
온도 범위	맞춤 구성 가능 (PTFE 보호 시 일반적으로 최대 250°C)
가열 표면 치수	CNC를 통한 완전 맞춤화 (최대 600mm x 400mm 또는 그 이상)
에칭 높이/두께	용기 요구 사항에 맞게 맞춤 지정
온도 균일성	전체 표면에서 ±1% ~ ±3% (치수에 따라 다름)
제어 시스템	서모커플 피드백이 있는 외부 디지털 PID 컨트롤러
절연층	고온 세라믹 섬유 또는 PTFE 코팅 복합재
전압 옵션	110V / 220V / 380V (단상 또는 삼상)
정격 전력	표면적 및 상승 속도 요구 사항에 따라 확장 가능
호환 실험실 기구	PTFE 비이커, PFA 튜브, 유리 기구, TFM 분해 탱크
벤치 보호	통합형 단열 베이스 지지대